



Prot. N.48104 del 30.07.2018

Direzione Gare, Contratti e Logistica
La Dirigente

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 ed in particolare l'art. 6 "Autonomia delle università";

Visto lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012, e successive modifiche;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 49150 del 22 dicembre 2015;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. e i. <<Codice dei contratti pubblici >>;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Pisa n. 177 del 10 giugno 2016, sulla quale ha espresso parere favorevole il Senato Accademico dell'Università di Pisa con delibera n.111 del 22 giugno 2016, con la quale è stato stabilito che, nelle more della revisione del Titolo VIII "Attività negoziale" del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, le disposizioni di cui al predetto Titolo VIII del vigente Regolamento e le relative disposizioni attuative continuano ad essere applicate se non in contrasto con le disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Considerato che è necessario procedere alla fornitura, installazione e posa in opera dell'attrezzatura **"RF/DC sputtering per la deposizione di film sottili di materiali elettricamente conduttivi e/o materiali isolanti mediante tecnologia Physical Vapor Deposition (PVD)"** per un importo a base di gara di Euro 82.000,00 oltre I.v.a., di cui costi per la manodopera per la posa in opera pari ad Euro 250,00 oltre I.v.a. compresi nell'importo stimato;

Visto in particolare, l'art. 54, comma 2, del predetto Regolamento, ai sensi del quale, <<con esclusione dei contratti di cui al comma precedente deliberati dal Consiglio di Amministrazione>>, la deliberazione a contrattare <<è adottata dai Responsabili dei Centri di gestione nell'ambito degli indirizzi stabiliti dagli organi centrali di governo e dai relativi consigli anche in sede di approvazione dei bilanci di previsione annuale.....>>.

Visto altresì l'art. 67, comma 2, del predetto Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 49150 del 22 dicembre 2015, ai sensi del quale <<tutti i Centri di gestione dell'Ateneo possono procedere agli acquisti di propria competenza, singolarmente o in comune, anche attraverso la struttura dell'Amministrazione centrale dell'Ateneo delegata a porre in essere le procedure necessarie ai sensi del presente regolamento>>.

Vista la delibera protocollo n.36669 dell'11.06.2018 con la quale il Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ha delegato la sottoscritta Dirigente della Direzione Gare,

Sigle:

Il Responsabile del Settore: Dott. Gabriele Tabacco _____

La Responsabile P.O.: Dott.ssa Giulia Appendino _____

Contratti e Logistica, che, con tale atto ha accettato la delega, all'espletamento delle procedure necessarie per l'acquisto della fornitura di **"RF/DC sputtering per la deposizione di film sottili di materiali elettricamente conduttivi e/o materiali isolanti mediante tecnologia Physical Vapor Deposition (PVD)"**;

Vista la suindicata delibera protocollo n.36669 dell'11.06.2018, con la quale sono stati approvati, tra l'altro, l'avviso per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, da svolgersi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), il modulo "manifestazione di interesse", il progetto dell'appalto in questione, costituito dalla relazione tecnico-illustrativa, dal capitolato speciale d'appalto e dallo schema di contratto mediante scambio di lettere;

Visto il proprio provvedimento protocollo n.41295 del 03.07.2018, dal quale, tra l'altro, risulta quanto segue:

- l'approvazione della relazione del RUP e della Dirigente della Direzione Gare, Contratti e Logistica allegati al provvedimento stesso sub.1;
- l'approvazione dell'elenco ditte da invitare alla procedura negoziata per la fornitura in parola così come risultante dall'allegato sub.1 al predetto provvedimento n.41295;

Vista la delibera a contrattare protocollo n.41913 del 05.07.2018 con la quale è stato autorizzato l'esperimento della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2106, sul sistema START per l'affidamento della fornitura **"RF/DC sputtering per la deposizione di film sottili di materiali elettricamente conduttivi e/o materiali isolanti mediante tecnologia Physical Vapor Deposition (PVD)"** per un importo a base di gara di Euro 82.000,00 oltre I.v.a., di cui costi per la manodopera per la posa in opera pari ad Euro 250,00 oltre I.v.a. compresi nell'importo stimato, mediante procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 ed è stato approvato il Progetto ai sensi dell'art.23, commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti comprensivo dei seguenti documenti: lettera di invito, relazione tecnico illustrativa, capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto mediante scambio di lettere, disciplinare di gara e schede allegate (DGUE, scheda dichiarazioni integrative, scheda consorziata, schede di avalimento art.89 e art.110, scheda offerta tecnica);

Visto che l'operatore economico che ha presentato offerta entro i termini prescritti negli atti di gara è la società **2M STRUMENTI S.r.l.** con sede in Roma (RM) in Via G. Pontano, 9 00141;

Vista la delibera prot. n. 46219 del 24 luglio 2018 con la quale è stata disposta l'approvazione del verbale della seduta di gara del 23 luglio 2018 e ammessa la ditta **2M STRUMENTI S.r.l.** alla successiva fase di gara;

Vista la regolarità dei verbali della procedura di gara del 23 luglio 2018 e del 27 luglio 2018 agli atti della Direzione Gare, Contratti e Logistica, che integralmente si approvano;

Preso atto che le caratteristiche ed i vantaggi dell'offerta selezionata sono indicati nel verbale datato 27 luglio 2018 che qui si allega in copia;

Rilevato che dal verbale della seduta del 27 luglio 2018 risulta che la Commissione di gara ha proposto di aggiudicare alla società **2M STRUMENTI S.r.l.** per l'offerta tecnica ed economica presentata in gara, per un importo della fornitura di **Euro 78.720,00** (I.v.a esclusa);

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 97 comma 6, ultimo periodo, l'offerta può essere ritenuta in ogni caso congrua;

Richiamato l'art. 29, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

DISPONGO

Art. 1) di approvare i verbali della procedura di gara in premessa del 23 luglio 2018 e del 27 luglio 2018 agli atti della Direzione Gare, Contratti e Logistica;

Art.2) di approvare l'aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento della fornitura, installazione e posa in opera dell'attrezzatura **"RF/DC sputtering per la deposizione di film sottili di materiali elettricamente conduttivi e/o materiali isolanti mediante tecnologia Physical Vapor Deposition (PVD)"** alla società **2M STRUMENTI S.r.l.** con sede in Roma (RM) in Via G. Pontano, 9 00141 per l'offerta tecnico economica presentata di **Euro 78.720,00** (I.v.a esclusa);

Art. 3) di aggiudicare la medesima procedura di gara alla citata società **2M STRUMENTI S.r.l.**;

Art. 4) di pubblicare il presente provvedimento, entro due giorni dalla sua adozione, sul profilo di committente, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi di quanto previsto dall' art. 29, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

Art. 5) di comunicare mediante PEC, contestualmente alla pubblicazione di cui all'art.4 del presente provvedimento, il presente provvedimento stesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29, comma 1 punto 3 del D.lgs. n. 50/2016.

Pisa,

Direzione Gare, Contratti e Logistica
La Dirigente - Dott.ssa Elena Perini
(firmato digitalmente)